- Манукян Г. А., Сторов М. Г. О распределения долговечностей при постромита иривых коррознолной усталости // Теория и конструирскачие машии: Межнуз темгб. саум. тр. по маш. – Ерепан. 1989. – С. 108–114.
- Степнов М. И. Статистические методы обработки репультатов механических нелытанай Справочник — М.: Машиностроесие, 1985.— 232 с.
- Ст. ян. М. Г., Маникан Г. Л. О форме крнвой коррозночной усталести при сложном -напружения // Иза. АН. АрмССР. Сер. ТИ – 1989 – Т. 42. № 5:– С. 213–218.
- 4 Олейник Н. В., Стихан М. Г. Осанесян Л. Г. Вероятностькая оценна тараметров релича чатружения залов // Надежность и долговечность машин и сокружений: Респ. междед. сб. науч. тр.— Киев. 1989. Вып. 16.— С. 46—55.
- Сезеринкан И. А. Лидчак Е. И. Методика испытании металлов на выякливость при циклическом изгиба и пульсирующем клучени 1. Заявод саб 1983.— Т. 49, № 6.— С. 81—83.
- Minoshima K., Okub. A., Komat K. Ctack initiation he a jor of yelic S.: under bending and torsional loads in high-strength steel I. Soc. Mater. Sci., 'ap. -1988, - 57, Nº 417, - P. 670-175
- 7. Расчетноя оценка сопротивления усталости валов при совместном нагибе и кручеими и воздухе и коррозновных средах /М. Г. Стакия, Л. Г. Оганески, Г. А. Манукии и др. Тез. докл. 111 Всезоюз, сими, «Прочность материалов и элементов ков трукции при сложном напряжечном состемчик». Житомир, 24 -26 окт-1989 г. Кисл. 1989. Ч. 2 — С. 21-22.
- 8 Стакия Манукия Г. 4. Вероятностная оценка сопротноления устало ли деталев, работающих в коррозношных средах // Теория и конструкровансе мощина: Межвод, тем. со, науч. тр. по машия.— Ереван, 1986. С. 21—25.

ЕрГИГим, К. Маркса.

20 XI 1989

H3B. All ApACCP (cop. 111). r. XEHI, № 4, 1990, c. 168-173

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

VHK 621 315,592

#### в. Е. АРУТЮНЯН

## ИНДУЦИРОВАННЫЙ СВЕТОМ ПОВОРОТ ОПТИЧЕСКОЙ ИНДИКАТРИСЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЛОМЛЕНИЯ В МОНОКРИСТАЛЛЕ СЕЛЕНИДА ПИНКА

Экспериментально о исследовано запязне мощности излучения подеветки в напряжения смещения на изворот и деформацию оптической индикатрисы показателей преломления в вы окоомном кубическом монокристалле селенида иника. Показано, что ответственными за фотоэлектр юлтический ффект в высокломоты кубическом 2л Se полупроводника. При подслетке излучением, приходящемся в область собственного поглощения, выспобождениме носители сплько илияют на электроолтические параметры исследуемого образия. Концентрация этях уровней определяет степень и звак де формации и поворота оптической издикатрисы показателен предомления, что может быть использовано при разработке электрооптических модуляторов на основе конокристалово селенида цилка в системах связи, лезерной локации и др.

Ил. 3. Баблиогр., 1 назв

В работе [1] сообщалось об исследовании в монокристалле селенида дрика зыдуанрованной светом оптической анизотронии. Было установлено, что неоднородное освещение различных областей крысталла вызывает различные по знаку приращения электроонтических вараметров.

В данной работе приводятся результаты исследования влияния мощно, та излучения подсветки и напряжения смещения на новорот и деформацию оптической индикатрисы показателей преломления в яысокоомном кубическом монокристалле селенила цинка В основе женериментов использовался известный динамический поляризационно-онтический метод [2]. Блок-схема устанозан вола тавлена на зв. 1. Пр лучение Не-Ne-лазера с длиной волны / = 0.6328 миля пр ходит тере поляризатор П., лиафратму Д. низу Л., упразменны стритескам полем э источника постоянного напряжения ШПН фало, нагающий элемент УФЭ, инследуемы: кристалл селеници занки авялизатор Х свето то марки КС-Ш и линзой П фокусирустся на чувствителизуюплощадку фотоприемника ФП. Силиал по-лелиего регистрируется селективным микровольтметром СВ-типа У2-8, выход которого полклю чен к сигнальному входу синхронного детектора СД гина В9-2 Анали затор установки снабжен верньерным устройством солтоэлектронным счетчиком и блоком автоматической инфровой индикации угла позоро та с точностью 0.1°. Для подсветки кристалла непользовалось налучение аргонового лазера типа ЛГ-106М с длиной волны  $\lambda = 0.488$  мля. которое системой зеркал З, и З, фокусировалось на входную торновуюгрань исследуемого кристалла и могло сканироваться с помощью юстировочного мехализма. Креме того, излучение полеветки может ослабляться с домощью поляризатора И2 и прерываться механическим модулятором М с регулируемой частотой вращения вала электродангателя. Контроль частоты модуляции в диапазоне 20-4000 Гц производился электронным частотомером Ч типа ЧЗ-32 по сигналу оптопары, установленной напротиз прорезей диска модулятора. Мощность излучения подсветки при необходимости контролировалась измерителем мощности лазерного излучения ИМ типа ИМО-2. На исследуемый образен помимо постоянного напряжения амплитудой до 1000 В от источника ИПП через развязывающее устройство РУ подавалось переменное напряжение амилитудой до 60 В с ныхола генератора ГШН типа ГЗ-34

Подсветка аргоновым лазером вызывала изменение электрооптических свойств кристалла Zn Se, и излучение He— Ne-лазера оказывалось промодулированным с частотой модуляции излучения подсветки. Сигнал, пропорциолальный амилитуде этой модуляции  $U_{d,SCR}$ , в дальнейшем называется сигналом фотоэлектрооптического эффекта (ФЭОПэффекта). В ходе экспериментов использовался высокоомный кубический монокристалл селенида цинка в виде прямоугольного бруска размерами 1,0×1,2×6,5 мм<sup>2</sup>. Зондирующее излучение распространялось вдоль направления [110], а электрическое поле было приложено вдольнаправления [001], поскольку в этой схеме достигается максимальная разность сдвига по фазе между обыкновенным п необыкновенным лучами [2].



Рас. 1. Схема установки.

Как известно, пропускание системы «поляризатор — электроонтический христалл—анализатор» описывается выражением [2]

$$\Phi = \cos^2\left(9 - \alpha\right) - \sin 2\alpha \sin 29 \sin^2\left(\Gamma, 2\right), \tag{1}$$

где а—угол между главной плоскостью поляризатора и одной из язведенных электрическим полем осей оптической индикатрисы показателей преломления,  $\beta$  угол между этой же осью и главной плоскостью анализатора,  $\Gamma = 2\pi l \Delta \eta$  — разность фаз между ортогональными компонентами излучения, проходящего через кристалл, l — длина кристалла,  $\Delta n$  — приращение главных осей сечения оптической индикатрисы. Для получения амплитудной модуляции обычно выбирают а = 45°,  $\rho$  = 135° и тогда  $\Phi$  = sin'(l'2). Если же  $\pi$  = 45°, a 3 = 90°, то  $\Phi$  = 0,5 и электрооптическая модуляция становится невозможной. В этом случае, если при подсветке оптическая индикатриса показателей преломления поворачивается на угол =  $\tau_0$  = 45° +  $\tau_1$  и 3 = = 90° +  $\tau_1$ . После простых преобразований выражения (1) получаем

$$\Phi = 0.5 | 1 - \sin 4\xi \cdot \sin^2 (\Gamma 2) |. \tag{2}$$

Из (2) легко получить апалитическое выражение для оценки угла поворота наведенных осей оптической индикатрисы

$$z = 0.25 \arcsin [(2^{4} - 1) \sin^2 (\Gamma/2)].$$
 (3)

Ранес было установлено, что различным по энаку приращениям электрооптических нараметров соответствуют различные по направлению повороты онтической инликатрисы [3]. Будем считать поворот положительным, ссли он происходит по часовой стрелке (ссли смотреть



Рис. 2. Зависимость фотоиндуцированного поворота глянных осей сечения онтической индикатрисы показителей преломления из мощности излучения подсветки: кривая 1 — поворот по часовой стрелке при подсветки и «+» точку, кривая 2 — инворот против часовой стрелки при подоветке и «-» точку.

навстречу лучу), и отрицательным, если наоборот. Кривые 1 и 2 (рис. 2) получены при непрерывной подсветке излучением аргонового лазера в присутствие постоянного напряжения смещения U. - 300В и синусоилального напряжения с амплитулой  $U_{\perp} = 50~B$  на частоте  $I_{\perp} =$ = 200 Ги Ход кривых [ [ (P) напоминает зависимость фотоиндуци рованного приращения показателя преломления от мощности излучения полсветки  $\delta$  ( $\Delta n$ ) = { (P), рассмотренной в [1], г. е. новорот оптической индикатрисы определяет величену  $\delta$  ( $\Delta n$ ) и се заинсимость от мощности Р. Симметрия кристалла селенида цинка исключает возможность явления фотоактивности, поэтому одновременное воздействие электрического поля и излучения подсветки приводит к локальному нарушению симметрии кристалла. Одной из причии такого возмущения может служить деформания решетки вблизи возбужденного центра. рассмотренная в [3]. В процессе поиска характеристических точек фотоэлектроонтического эффекта освещаются различные участки кристалла. Высвобожденные свстом носители из возбужденного центра ваменяют эффективный раднус взанмодействия этого центра с кристаланческой решеткой. В результате, решетка деформируется с соответствующим локальным нарушением симмстрии кристалла. При подсвет ке в «+» точке происходит локальное сжатие, а в «--» точке - локальчое растяжение кристаллической решетки.

Из сравнения кривых на рис. 2 видно, что положительный поворот и мощность точки насыщения больше по величине отринательного новорота главных осей и мощности насыщения (~ 4 раза). Если предположить, что различные по знаку повороты осей связаны с возбуждением различных типов центров (обозначим их для удобства « +» центры для положительного поворота, а для отрицательного - : — центры), тогда концентрация «+» центров значительно больше вынситралия «--» центров, Воздействие различных тивов центров на величину



Рик 3. Зависимость фотонидуцированного поворота главных осен село и подликатрисы от наприжения смещения по кристалле кризан 1— при п светке и — точку, кривая 2— при подсветке в — точку

сигнала фотоэлектроолтической модуляния подтверждают . тольтаты измерения ниергисаности эффекта (в «-)-» точке т = 2,3-10 ч с, в лля «--» точки т = 10 3с). Для исследования завленмости онтаческой видякатрисы показателей предомления от величниы электрического поля на образел подавалось постоянное напряжение смещения различной амплитуды. На рис. З приведены кривые зависимости  $z = f(U_{cu})$ . В исохлном состояния U су = 0, кривая 1 соответствует положительному, а кривая 2 отрицательному повороту видикатрисы. Мощность излучения подеветки в эксперименте поддерживалась постоянной и равной 10 Вт. Обе кривые асимметричны относительно начала координат и входят в режим насыщения. Асимметрия кривых связана с различной концентрацией возбужденных центров обонх тинов, а на линейном VНАСТКО : НО ЗАВИСИТ ОТ АМПЛИТУЛЫ СИНУСОНДАЛЬНОГО НАЗРЯЖСНИЯ, ПРИложенного к кристаллу Zn Se, что наблюдалось и в [4]. Наличие области насыщения указывает на го, что и системе «кристалл- электричеэкое поле» виступило равновесие. В рамках предполагаемой теформаи овлой модели ФЭОП эффекта этот факт приобретает вноди конкретный физический смыся: решетка растягивается или сжимается до определенной яеличины. Поскольку концентрания «--» центров больше, го соответствующий максимально достижимый поворот эначительно больше. Крутизна характеристики (кривая 1) на линейном участке закже больше, Так как «--» центров меньше, то и крутизна соответ изующей

172

характеристики (кривая 2) мольше, а напряжение, при котором наступаст насыщение, больше в два раза. При подаче отрицательного напряжения смещения на кристалл обе кривые также входят в насыщение при различных напряжениях, по при равных углах  $\xi \approx 8^{\circ}$ 

Ответственными за фотоэлектроонтический эффект и высокномном кубическом монокристалле селенида цинка являются мелкие уровни, рвсположенные в запрещениой зоне полупроводика на различной глубине. При полевстке кристалла излучением, приходящимся в область собственного поглощения, высвобожленные носители сильно влияют на электрические нараметры исследуемого образца. Концентрация этах уровней определяет степень и звак деформации и поворота онтической видекатрисы показателей преломления кристалла, что может быть иснользовано при разработке электропатических модуляторов на основе селенида цинка в системах связи, лазерной локации и др.

## литература

- Арутмиян В. Е. п. др. Эффект фотовидуцированного двухлучепреломления в криссталах GaP п. Zn Sc. // Тр. Всес. хонф. по. физике полупроводинков. Баку: Изд. ос. Эдм», 1982. – Т. 2. С. 58–59.
- Сонин А. С. Висиловская А. С. Электроонтические консталлы М.: Атамизант. 1971 — 328 с.
- Салосе Э. Ю. и др. Фотоиндушированные изменения приращения похазаться предомления в полицолирующем Ga 15 (Cr) // Дока АН АзССР.— 1986. Т. 42. 5. 4.— С. 16—18.
- Аколык Р. М. н. гр. Олгански я ализотволия подупров танковых согим зий А284.
  Класаленная пространственно силостией // ФТП 1986.— Г. 20. № 8.— С. 1438—1443.

НТО ИРФЭ — Степлиакерте

20, IV, 1990

Han All ApACCP (rep 34) r MLHI, No I, 1590, r 173--177

### радноэлектроника

**VAK 621.3.049** 

#### D. M. APSTICHSHI, A. A. KAPATESOB,

# К АНАЛИЗУ ПЕОДНОРОДНЮСТИ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МАТРИЧНЫХ ФОТОПРИЕМНЫХ ПРИБОРОВ С ЗАРЯДОВОЙ СВЯЗЬЮ

Исследуется неоднородью ть фоточувствительности козерхности матричных фотоприемников на приборах с зарядовой связью. Прознализированы онибки, зносимые указащных фатории при приеме оптического сигнал. Принидены экспериментальные разультаты для матриц типа A1012.

На 4. Библиогр.: 3 назв.

Հետազոտված է չիցրային կապով ֆոաորնդունիչներում մակերևսի ֆոաոդպալունության դորմաձութ, Բուսանաշրիրվ են հղմած փաստով ստեղծվող օխալները ոպտինական ազդաաչանի բեղունվուն ժամանակ։ ՌՀՀ տիպի մատրիդաների համաս բնրված են փորձաբարական ավյալեւ,